

微細加工実践セミナー

文部科学省委託事業である " ナノテクノロジープラットフォーム " の一環として、微細加工実践セミナーを開催します。産学官の研究者に、超微細加工に関する装置やその利用例を学習する場と、それらの技術を実地に習得する機会を提供し、ナノテクノロジーにおける技術力向上のための継続教育に貢献することを目的としています。

本セミナーでは、微細加工技術の概論を電子ビーム描画、マスクレス露光、反応性イオンエッチングに分けて分かりやすく解説するとともに、微細加工の異分野への応用事例を紹介することで、より具体的なイメージが持てるような構成になっています。また、東京工業大学、産業技術総合研究所において、実際の装置を使った無料の操作実習プログラムをご用意しています。産学官にかかわらず、多くの皆様のご参加をお待ちしています。

日 時：2013年9月30日（月）13時～

場 所：産業技術総合研究所 つくば中央第2事業所 2-12 棟第6会議室

http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/tsukuba_map_main.html

参加費：無料

13:00～13:05	Opening
13:05～14:05	『電子線描画技術(EB描画)』 宮本 恭幸 (東京工業大学)
14:05～14:50	『マスクレス露光技術とその先端的活用技術』 木村 一彦 (株式会社ナノシステムソリューションズ)
14:50～15:10	休憩
15:10～15:55	『プラズマエッチング技術』 中村 敏幸 (株式会社アルバック)
15:55～16:15	『微細加工の応用事例紹介 - マイクロ流路作製の深堀エッチング支援 -』 蜂谷 智央 (産業技術総合研究所)
16:15～17:05	『微細加工技術の医療応用』 安 隆則 (獨協医科大学医学部)
17:05～17:10	Closing

実習：2013年10月1日（火）～4日（金）

コース	定員	日程
東京工業大学／産業技術総合研究所	電子線描画	4名 10月1日～4日*
産業技術総合研究所	マスクレス露光	4名 10月1日
産業技術総合研究所	ドライエッチング	4名 10月1日

* 東京工業大学、産業技術総合研究所での実習は4日間のコースです。

■お申し込み開始 >>> 8月29日（木）10:00

■お申し込み先 >>> <https://nanoworld.jp/npf/training/h25-2/>

